

| LT-R 系列 | 反射膜厚仪

20
nm

超薄厚度测量

±1
nm

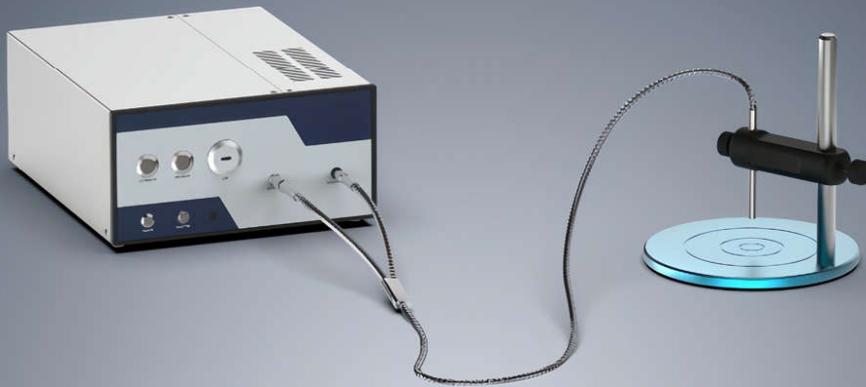
超高线性精度

最高 **100**
Hz

超快的采样速度

0.05
nm

超高重复精度



◆ 为什么选择泓川科技？



自定膜结构测量



抗干扰能力强



纳米级测量精度



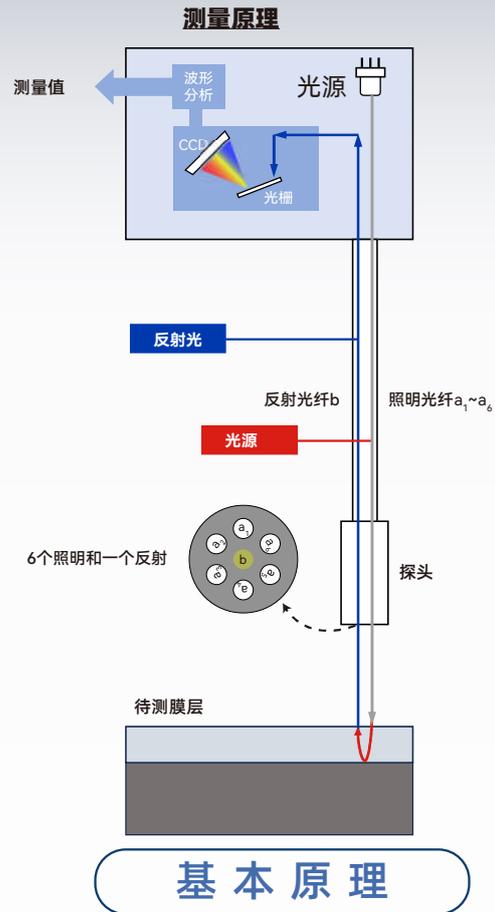
多层透明测厚



硬薄膜测量



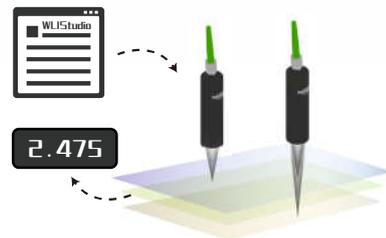
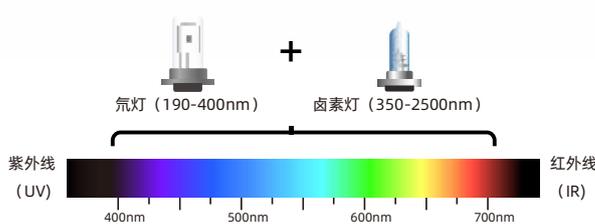
小巧易安装



光入射到薄膜后上下表面反射回光会发生干涉，其反射谱取决于薄膜的特性，包括光学常数和粗糙度等，可从一定波段范围内的反射光谱通过模型拟合解析出薄膜厚度、厚度。

高强度组合光源

泓川科技设计采用高强度氙灯和卤素灯组合光源，光谱覆盖紫外可见光到近红外范围，极大提高测量稳定性和灵敏度；结合高效模型拟合分析算法可解析单层膜到多层薄膜。

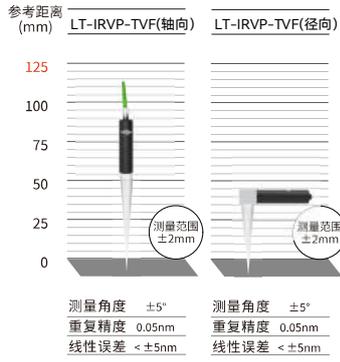


强抗干扰的系统设计

泓川科技采用高灵敏度、高信噪比的元器件，大大减少了噪声干扰；独特的模型多参数反演算法能够大大提高外部扰动能力；创新的光学系统设计保证在物理受限或恶劣环境下仍可稳定测量。



产品规格一览



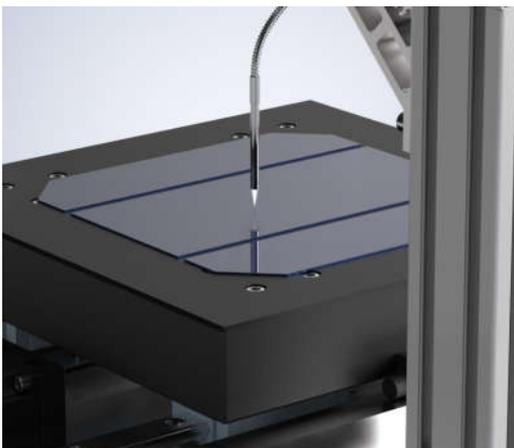
应用案例



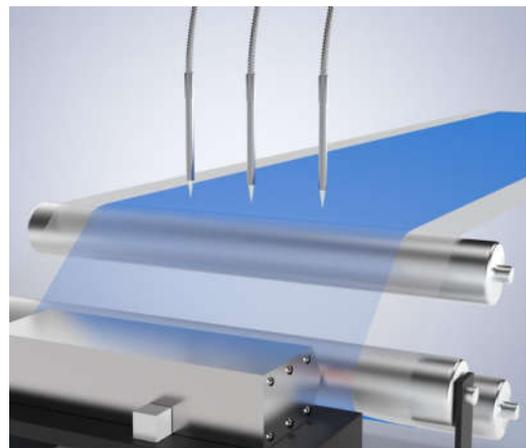
◆ 液晶显示膜厚测量



◆ 喷涂膜厚测量



◆ 光伏硅片Poly层膜厚测量



◆ 精密涂布膜层测厚

产品参数表

| 系列名称 | | LTRUVC | |
|-------------|--------------------------------|---|--|
| 控制器型号 | LTRUVC-100 | | |
| 适配探头型号 | LTP-T10-UV-VIS (弥散光斑) | LTVP-TVF (聚焦光斑) | |
| 参考距离*1 | 非聚焦光束, 建议安装距离5~10mm | 安装侧面出光附加镜时: 34.5mm±2mm 轴向出光时: 55mm±2mm | |
| 测量角度*2 | ±10° | ±5° | |
| 光斑直径*3 | 弥散光斑; 在10mm安装距离时, 光斑直径约为4mm | 约200μm | |
| 光源波长范围 | | | |
| 重复精度*4 | 0.05 nm | | |
| 准确度(取较大值)*5 | <±1 nm 或 ±0.3% | | |
| 外径*长度 | φ6.35*3200mm*6 | φ20*73mm | |
| 探头重量 | 190g | 108g(探头)、49g(附加镜) | |
| 外壳防护等级 | IP40 | | |
| 采样频率 | Max.100 Hz (视求解参数复杂度而定) | | |
| 测厚范围 | 约20nm~50μm (折射率1.5时) | | |
| 测控软件 | 上位机软件 | WLIStudio | |
| | 二次开发包 | WLI-SDK | |
| 额定功率 | 电源电压 | 220V±20V 50Hz AC | |
| | 最大功率 | 50W | |
| 环境耐性 | 工作温度 | 10~40°C | |
| | 相对湿度 | 20 %至 85% RH (无冷凝) | |
| 控制器重量 | 5kg | | |

*1 在测量过程中, 建议保持被测物与探头距离相对恒定

*2 在测量过程中, 建议保持被测物与探头角度相对恒定

*3 TS-IRVP-TVF工作距离可以在35~200mm之间变动, 如有特定的工作距离定制需求, 请联络销售经理提前预定。

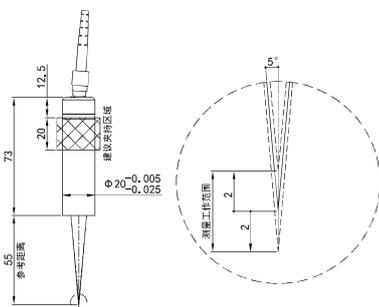
*4 测量100nm二氧化硅标准物质, 连续采集1000组数据的1倍标准偏差。

*5 测量二氧化硅标准物质, 连续采集100组数据的平均值与标称值的偏差。

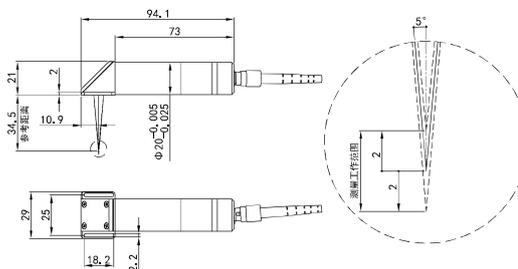
*6 长度3200mm为探头线缆的总长度。

产品及附件尺寸图

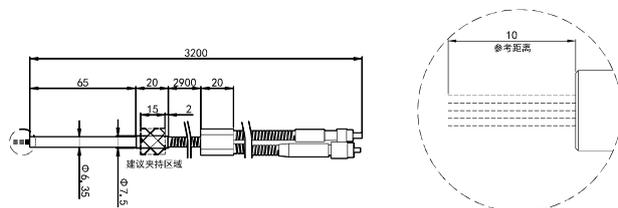
LTP-IVF (轴向)



LTP-IVF (径向)



LTP-T10-UV-VIS



FC光纤跳线

